

第109回分析基礎セミナー

原理から学ぶ機器分析【1】 走査電子顕微鏡

【日時】 2017/4/19 (水) 13:00-17:00

【場所】 九州大学伊都キャンパス・工学部大講義室 (総合学習プラザ2F)

【主催】 九州大学中央分析センター

【共催】 九州大学ナノテクノロジープラットフォーム

【協力】 株式会社日立ハイテクノロジーズ

13:00-14:05 原理から学ぶ走査電子顕微鏡

SEM (Scanning Electron Microscope) とは何か、また、SEMでどのような情報が得られるのか、装置構成を含め、SEMの原理と基礎を解説します。

14:05-15:05 SEM観察のための前処理技術

SEM観察にあたってはどのような準備が必要なのか、前処理方法および前処理装置に関して解説します。

15:20-16:00 目的別SEMの選択法

実際のSEM利用にあたり、中央分析センターに装置されている日立ハイテクノロジーズ製SEMの特徴、使い分けを解説します。

16:00-17:00 SEMの観察テクニックと応用技術

SEMを使用する際に起こりうる障害に対し、解決方法、観察テクニックの解説をします。併せて最新の観察応用技術の紹介を行います。

近年、分析装置の操作性は格段に向上し、マウス一つで操作が完結する場合も珍しくありません。一方、機器の原理が曖昧なままでもデータが取得でき、その解釈を誤まるという危険性ははらんでいます。今年度のセミナーは、基本に立ち返り、原理をよく理解してより良いデータを取得し、正しい解釈ができることを目指します。初回は、多様な分野の研究・開発に必要不可欠で、当分析センターでも利用者ニーズが高い走査電子顕微鏡です。学内外どなたでもご参加できます。事前の参加登録にご協力をお願いします。

【問合せ・申込先】

九州大学中央分析センター伊都分室 渡辺 TEL092-802-2857
watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp